

DERWENT-ACC-NO: 1995-095550

DERWENT-WEEK: 199513

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION
LTD

TITLE: Semiconductor device package
mfg. method - by aligning
respective guiding holes formed on
its surface for back
process positioning of the frame

PATENT-ASSIGNEE: FUJITSU LTD[FUIT]

PRIORITY-DATA: 1993JP-0162844 (June 30,
1993)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE
LANGUAGE	PAGES
JP 07022563 A	January 24, 1995
N/A	013
	H01L 023/50

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR
APPL-NO	APPL-DATE
JP 07022563A	N/A
1993JP-0162844	June 30, 1993

INT-CL (IPC): H01L023/50

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 07022563A

BASIC-ABSTRACT:

The method involves usage of a supporting frame which is provided with guiding holes on its surface. A lead frame having guiding holes is mounted on the supporting frame in a face down pattern so that the junction between the two frames are well aligned. This is obtained by positioning the respective guiding holes of the supporting and the lead frame one above the other. The whole structure constitutes a frame assembly unit.

ADVANTAGE - Carries out smooth positioning of frames. Improves efficiency of

manufacturing process.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/27

TITLE-TERMS: SEMICONDUCTOR DEVICE
PACKAGE MANUFACTURE METHOD ALIGN
RESPECTIVE

GUIDE HOLE FORMING SURFACE
BACK PROCESS POSITION FRAME

DERWENT-CLASS: U11

EPI-CODES: U11-D01A1; U11-D03A1A;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers:

N1995-075339

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-22563

(43) 公開日 平成7年(1995)1月24日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 1 L 23/50

識別記号

K

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願平5-162844

(22) 出願日 平成5年(1993)6月30日

(71) 出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72) 発明者 音喜多 孝輔

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72) 発明者 佐藤 光孝

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72) 発明者 林田 勝大

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74) 代理人 弁理士 伊東 忠彦

最終頁に続く

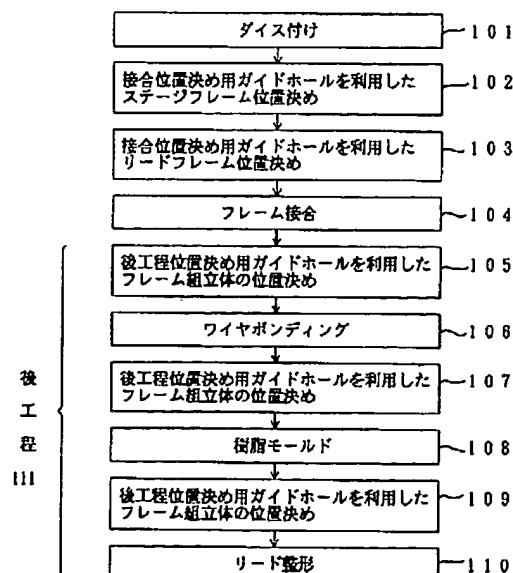
(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 本発明はフレーム組立体を利用した半導体装置の製造方法に関し、フレーム組立体の位置決めを円滑化させて半導体装置の製造の能率化を実現することを目的とする。

【構成】 ステージフレーム80は、接合位置決め用ガイドホール83と逃がし穴84を有する。リードフレーム90は、接合位置決め用ガイドホール94と後工程位置決め用ガイドホール95を有する。両フレーム80、90は、ガイドホール83、94とを利用して位置合わせして接合され、フレーム組立体124を得る。その後の工程において、フレーム組立体124は、リードフレーム90の後工程位置決め用ガイドホール95のみを利用して位置決めするよう構成する。

本発明の半導体装置の製造方法の一実施例の工程図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 フレームを複数枚接合してなるフレーム組立体を用いて半導体装置を製造する方法において、フレームを、全部のフレーム（80、90）に接合位置決め用ガイドホール（83、86、94、97）を有し、一のフレーム（90）に後工程位置決め用ガイドホール（95、98）を有する構成とし、

上記フレーム組立体を、各フレームの接合用位置決め用ガイドホールを利用してフレーム同士を位置合わせして接合することにより製造し、

その後の工程においては、該フレーム組立体を、上記一のフレームの後工程位置決め用ガイドホールを利用して位置決めする構成としたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】 ステージを有するステージフレーム（80）に、半導体チップをダイス付けするダイス付け工程（101）と、

ダイス付けされたステージフレームにリードを有するリードフレーム（90）を重ねて接合するリードフレーム接合工程（104）と、

接合されたフレーム組立体を樹脂封止する樹脂モールド工程（108）を含む後工程（105～110）とよりなる半導体装置の製造方法において、

該ステージフレーム（80）及びリードフレーム（90）を、双方が対応する部位に同一径の接合位置決め用ガイドホール（83、86、94、97）を有し、一方が後工程位置決め用ガイドホール（95、98）を有し、他方が、該後工程位置決め用ガイドホールの部位に、上記後工程位置決め用ガイドホールより大径の逃げ部（84、87）を有する構成とし、

上記リードフレーム接合工程においては、上記ステージフレームの接合位置決め用ガイドホールと上記リードフレームの接合用ガイドホールとをガイドピンに嵌合させて、上記ステージフレームと上記リードフレームとを位置合せし、

上記後工程においては、上記後工程位置決め用ガイドホールをガイドピンに嵌合させ、該後工程位置決め用ガイドホールにより、上記フレーム組立体を位置決めする構成としたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は半導体装置の製造方法に係り、特にフレームを複数重ねて接合してなるフレーム組立体を用いて半導体装置を製造する方法に関する。

【0002】半導体装置は、リードを曲げて整形する最終工程の直前までは、細長のリードフレームを一の単位として取り扱って、ダイス付け工程、ワイヤボンディング工程、樹脂成形工程を経て製造される。

【0003】上記の各工程は、リードフレームに形成してあるガイド孔を、樹脂成形装置等の位置決めピンに嵌

合させて、リードフレームを上記装置に位置決めして行なっている。

【0004】フレームを複数重ねて接合してなるフレーム組立体を用いて半導体装置を製造する場合においても、各製造工程において、フレーム組立体を位置決めする必要がある。

【0005】

【従来の技術】図16は、例えば特開昭59-66157号（特公平4-1503号）に示されている半導体装置10の製造方法の1例を示す。

【0006】半導体装置10は、図17に示すように、ステージ11、半導体チップ12、ワイヤ13及びインナーリード14が樹脂パッケージ15により封止され、樹脂パッケージ15の側面（図17中、背面側に位置する側面）よりアウターリード16が延出している構造を有する。

【0007】上記構造の半導体装置10は、以下に説明するように製造される。

【0008】(1) ダイス付け工程21

20 図18に示すステージフレーム40のステージ11上に半導体チップ12をダイス付けする。

【0009】(2) ステージフレームの位置決め工程22 図21に示すように、ダイス付けされたステージフレーム40のガイドホール41、42を治具43のガイドピン44、45に嵌合させて、ステージフレーム40を位置決めする。

(3) リードフレームの位置決め工程22

30 図19に示すリードフレーム46のガイドホール47、48をガイドピン44、45に嵌合させ、図21に示すように、リードフレーム46をステージフレーム40上に重なった状態で位置決めする。

【0010】ステージフレーム40とリードフレーム46とは、図20に示す位置関係とされる。

【0011】(4) フレーム接合工程24

位置決めされているフレーム46と40とを溶接して、接合する。これにより、図22に示すフレーム組立体49を得る。

【0012】50は溶接された部分である。

【0013】51は積重ガイドホールであり、ガイドホール41とガイドホール47とが重なった構造である。

【0014】52は積重ガイドホールであり、ガイドホール47とガイドホール48とが重なった構造である。

【0015】(5) フレーム組立体49の位置決め工程25（図23参照）

フレーム組立体49を、その積重ガイドホール51、52を夫々ガイドピン53、54に嵌合させて、ワイヤボンディング装置55に位置決めする。

【0016】(6) ワイヤボンディング工程26

50 上記のように位置決めした状態で、ワイヤボンディングを行う。

【0017】(7) フレーム組立体49Aの位置決め工程27(図24参照)

ワイヤボンディング装置から、ワイヤボンディングがされたフレーム組立体49Aを取り外し、次いでその積重ガイドホール51, 52を夫々ガイドピン56, 57に嵌合させて、樹脂成形金型58に位置決めする。

【0018】(8) 樹脂モールド工程28

上記のように位置決めした状態で、樹脂モールドを行う。

【0019】(9) フレーム組立体49Bの位置決め工程29(図25参照)

樹脂成形金型58から、樹脂パッケージ15が形成されたフレーム組立体49Bを取り外し、次いでその積重ガイドホール51, 52を夫々ガイドピン59, 60に嵌合させて、リード整形装置61に位置決めする。

【0020】(10) リード整形工程30

フレーム組立体の不要部分であるタイバー200等を切断すると共に、アウトリードを曲げて整形する。

【0021】以上により、図17に示す半導体装置10が製造される。

【0022】上記のように、従来は、フレーム40と46とを接合してフレーム組立体49を形成した後は、積重ガイドホール51, 52を利用して位置決めして、フレーム接合後の工程であるワイヤボンディング、樹脂モールド、及びリード整形を行っていた。

【0023】

【発明が解決しようとする課題】ステージフレーム40のガイドホール41及びリードフレーム46のカイドホール47の径は、ガイドピン44の径より若干大きいため、図16の工程22, 23によりフレーム40, 46を位置決めした状態において、ガイドホール41と47とは、図26に拡大して示すように若干ずれた状態となり易い。

【0024】フレーム40と46とがこの状態で接合されると、積重ガイドホール51は、図27(A), (B)に示すように、ガイドホール41の軸線41aとガイドホール47の軸線47aとがずれた状態となってしまう。

【0025】別の積重ガイドホール52についても、上記と同じく、ガイドホール42と48が若干ずれた状態となり易い。

【0026】このため、ガイドホール41(42)と47(48)とのずれの程度によっては、積重ガイドホール51, 52とガイドピン53, 54等の間の隙間が無くなり、図16中の工程25, 27, 29において、積重ガイドホール51, 52をガイドピン53, 54, 56, 57, 59, 60に嵌合させるとき及び各ガイドピンより引き抜くときに、きつくなり、場合によっては抜けなくなったりすることが起きる。

【0027】この場合には、作業者がフレーム組立体を

ガイドピンより引き抜くまでワイヤボンディング、樹脂モールド、リード整形が一時的に中断することになり、半導体装置の生産数が少なくなってしまう。

【0028】また、積重ガイドホール51, 52のガイドピンへの嵌合が及び引き抜きがきつくなると、嵌合、引き抜きを各工程25~30で何回も行っている間にフレーム組立体49が変形して波打ったようになり、各部分に変形して、ワイヤボンディング及びリード整形が正常に行なわれなくなったりする等の種々の不都合が生ずる虞れもあった。そこで、本発明は、フレーム接合工程以後の工程においては、フレーム接合に際してフレーム位置決めのために使用したガイドホールとは別のガイドホールを使用するようにして、フレーム接合工程以後の各工程におけるフレーム組立体の位置決めの円滑化を実現した半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。

【0029】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、フレームを複数枚接合してなるフレーム組立体を用いて半導体装置を製造する方法において、フレームを、全部のフレームに接合位置決め用ガイドホールを有し、一のフレームに後工程位置決め用ガイドホールを有する構成とし、上記フレーム組立体を、各フレームの接合用位置決め用ガイドホールを利用してフレーム同士を位置合わせして接合することにより製造し、その後の工程においては、該フレーム組立体を、上記一のフレームの後工程位置決め用ガイドホールを利用して位置決めする構成としたものである。

【0030】請求項2の発明は、ステージを有するステージフレームに、半導体チップをダイス付けするダイス付け工程と、ダイス付けされたステージフレームにリードを有するリードフレームを重ねて接合するリードフレーム接合工程と、接合されたフレーム組立体を樹脂封止する樹脂モールド工程を含む後工程とよりなる半導体装置の製造方法において、該ステージフレーム及びリードフレームを、双方が対応する部位に同一径の接合位置決め用ガイドホールを有し、一方が後工程位置決め用ガイドホールを有し、他方が、該後工程位置決め用ガイドホールの部位に、上記後工程位置決め用ガイドホールより大径の逃げ部を有する構成とし、上記リードフレーム接合工程においては、上記ステージフレームの接合位置決め用ガイドホールと上記リードフレームの接合用ガイドホールとをガイドピンに嵌合させて、上記ステージフレームと上記リードフレームとを位置合せし、上記後工程においては、上記後工程位置決め用ガイドホールをガイドピンに嵌合させ、該後工程位置決め用ガイドホールにより、上記フレーム組立体を位置決めする構成としたものである。

【0031】

【作用】請求項1のフレーム同士を接合した後は、一の

フレームの位置決め用ガイドホールを利用して位置決めする構成は、フレーム同士の位置ずれがフレーム組立体の位置決めに影響を及ぼさないように作用する。

【0032】請求項2の逃げ部を設けた構成は、フレーム組立体を位置決めするガイドピンと干渉しないように作用する。

【0033】

【実施例】図1は本発明の一実施例になる半導体装置の製造方法の工程を示す。

【0034】説明の便宜上、まず本発明の製造方法によって製造された半導体装置の構造について、図2を参照して説明する。

【0035】半導体装置70は、ステージ71、半導体チップ72、ワイヤ73及びインナーリード74が樹脂パッケージ75により封止され、樹脂パッケージ75の側面からアウターリード76が延出している構造を有する。

【0036】次に、半導体装置の製造方法に使用するステージフレーム及びリードフレームについて説明する。

【0037】図3に示すように、ステージフレーム80は、中央にステージ81を有し、一側のクレイドル部82に、接合位置決め用ガイドホール83及び逃げ部としての逃がし穴84を有し、他側のクレイドル部85にも、接合位置決め用ガイドホール86及び逃げ部としての逃がし穴87を有する構成である。

【0038】図4に示すように、リードフレーム90は、中央に、インナーリード91及びアウターリード92を有し、一側のクレイドル部93に、接合位置決め用ガイドホール94及び後工程位置決め用ガイドホール95を有し、他側のクレイドル部96に、接合位置決め用ガイドホール97及び後工程位置決め用ガイドホール98を有する構成である。

【0039】ガイドホール83と94、及びガイドホール86と97は、夫々対応する部位に形成してあり、全て同一径 d_{10} を有する。

【0040】逃げ穴84とガイドホール95、及び逃げ穴87とガイドホール98が夫々対向する部位に形成してある。

【0041】ガイドホール95、98は共に径 d_{11} を有する。

【0042】逃がし穴84、87の径 d_{12} は、上記のガイドホール95の径 d_{11} より0.3mm程度大きい。

【0043】なお、 $(d_{12}-d_{11})=0.3\text{mm}$ は、ステージフレーム80とリードフレーム90との間に起こりうる位置ずれ量の約倍となるように定めてある。

【0044】なお、上記のガイドホール83、86は、元々はステージフレーム80を製造するときに位置決め用として使用されていたものである。

【0045】また、ガイドホール94と97は、リードフレーム90を製造するときに、位置決め用として使用

されていたものである。

【0046】ステージフレーム80とリードフレーム90とを対応させて示すと、図5に示す如くなる。

【0047】次に、上記の構成のステージフレーム80及びリードフレーム90を使用して、図2の半導体装置70を製造する方法について、図1を参照して説明する。

【0048】(1) ダイス付け工程101

図3に示すステージフレーム80のステージ81上に、半導体チップ72をダイス付けする。

【0049】(2) ステージフレームの位置決め工程102

図6(A)、(B)に示すように、ダイス付けされたステージフレーム80の接合位置決め用ガイドホール83、86を、フレーム接合装置120のガイドピン121、122に嵌合させて、ステージフレーム80を位置決めする。

【0050】(3) リードフレームの位置決め工程103

図7(A)、(B)に示すように、リードフレーム90の接合用位置決め用ガイドホール94、95を、ガイドピン121、122に嵌合させ、リードフレーム90をステージフレーム80上に重ねた状態で位置決めする。

【0051】ステージフレーム80とリードフレーム90とは、図5に示す位置関係となる。

【0052】(4) フレーム接合工程104

位置決めされているステージフレーム80とリードフレーム90とを、図7(A)中、符号123で示す箇所を溶接して、接合する。

【0053】これにより、図8に示すフレーム組立体124を得る。

【0054】図1中、フレーム接合工程24の次の工程から以後の工程を総称して後工程IIIという。

【0055】以後のワイヤボンディング工程等においてフレーム組立体124を位置決めするには、後工程位置決め用ガイドホール95、98を使用する。

【0056】このガイドホール95、98と逃がし穴84、87とは、図5より分かるように同軸的に配してある。

【0057】(5) フレーム組立体124の位置決め工程105

図9(A)、(B)に示すようにフレーム組立体124を、そのステージフレーム80の逃がし穴84とリードフレーム90の後工程位置決め用ガイドホール95とを、ワイヤボンディング装置125のガイドピン126に嵌合させ、別の逃がし穴87と後工程位置決め用ガイドホール98とを、ガイドピン127に嵌合させて、ワイヤボンディング装置125に位置決めする。

【0058】(6) ワイヤボンディング工程106

このように位置決めした状態で、ワイヤボンディングを行う。

【0059】ワイヤボンディングが完了すると、ワイヤボンディングがされたフレーム組立体124Aが引き上げられ、ガイドホール95、98がガイドピン126、127より抜かれる。

【0060】(7) フレーム組立体124Aの位置決め工程107

図10(A)、(B)に示すように、ワイヤボンディングがされたフレーム組立体124Aを、その逃がし穴84とガイドホール95とをガイドピン128に嵌合させ、逃がし穴87とガイドホール98とをガイドピン129に嵌合させて、樹脂成形金型130に位置決めする。

【0061】(8) 樹脂モールド工程108

上記のように位置決めした状態で、樹脂モールドを行う。

【0062】モールドが完了すると、樹脂モールドがされたフレーム組立体124Bが引き上げられ、ガイドホール95、98がガイドピン126、127より抜かれる。

(9) フレーム組立体124Bの位置決め工程109

図11(A)、(B)に示すように、樹脂モールドされたフレーム組立体124Bを、その逃がし穴84とガイドホール95とをガイドピン131に嵌合させ、逃がし穴87とガイドホール98とをガイドピン132に嵌合させて、リード整形装置133に位置決めする。

【0063】(10) リード整形工程110

フレーム組立体124Bを、図11(A)中、大略線134、135、136、137の個所で切断し、その後アウターリード92を曲げて整形する。

【0064】以上により、図2に示す半導体装置70が得られる。

【0065】次に、工程105、107、109の特長について説明する。

【0066】(1) ステージフレーム80とリードフレーム90とが位置ずれなく接合された場合

図12(A)、(B)に示すように、ガイドホール95と逃がし穴84とは、夫々の軸線95a、84aが一致している状態にある。

【0067】このため、逃がし穴84はガイドピン126(128、131)には接触せず、隙間140を有する状態となり、ガイドホール95だけがガイドピン126(128、131)に位置規制されて嵌合する状態となる。

【0068】従って、フレーム組立体124(124A、124B)のワイヤボンディング装置等への取り付け及び取り外しは円滑に行われる。

【0069】(2) ステージフレーム80とリードフレーム90とが位置ずれして接合された場合

図13(A)、(B)に示すように、ガイドホール95と逃がし穴84とは、夫々の軸線95a、84aが必ず

れている。

【0070】しかし、逃がし穴84の周壁は、ガイドホール95の内側には進入していない。

【0071】このため、逃がし穴84はガイドピン126(128、131)には接触せず、依然として隙間141を有する状態となり、ガイドホール95だけがガイドピン126(128、131)に位置規制されて嵌合する状態となる。

【0072】従って、フレーム組立体124(124A、124B)の装置への取り付け及び取り外しは、円滑に行われる。

【0073】この結果、図1中の後工程III(105~110)は、フレーム組立体124のうち上側に位置するリードフレーム80のみが位置規制されて行われ、フレーム組立体124(124A、124B)の取り付け、取り外しがとどこおることが原因で中断することなく円滑に行われ、半導体装置70は能率良く製造される。

【0074】また、フレーム組立体124に曲がり等も発生せず、ワイヤボンディング及びリード整形は精度良く行われる。

【0075】次に本発明の変形例について説明する。

【0076】〔第1の変形例〕図14(A)、(B)に示すように、上記実施例とは逆に、上側のリードフレーム90Aに逃がし穴84A、87Aを設け、下側のステージフレーム80Aにガイドホール95A、97Aを設けた構成としてもよい。

【0077】フレーム組立体のうちステージフレーム80Aのみが位置規制される。

【0078】〔第2の変形例〕上記の逃がし穴84、87の代わりに、切り欠きを設けた構成としてもよい。

〔第3の変形例〕第2の変形例を発展させて、図15に示すようにステージフレーム80Bをリードフレーム90Bより幅狭とし、ガイドホール95B、97Bの下側にはステージフレーム80Bが存在しないようにしてもよい。

【0079】83B、86B、94B、97Bは接合位置決め用ガイドホール、95B、98Bは後工程位置決め用ガイドホールである。

【0080】〔第4の変形例〕フレーム組立体がフレームを三枚以上積層してなる構成にあっては、一のフレームにガイドホールを設け、他のフレームには逃がし穴を設けて構成する。

【0081】

【発明の効果】以上説明したように、請求項1の発明によれば、フレーム組立体がフレーム間に位置ずれがある場合であっても、フレーム組立体を後の工程において、位置決め及び位置決め解除を共に円滑に行うことが出来る。従って、フレーム組立体の流れが中断することが無く、よって、フレーム組立体を用いた半導体装置を効率

良く生産出来る。

【0082】またフレームの変形が生ぜず、後工程を精度良く行うことが出来る。

【0083】請求項2の発明によれば、フレーム組立体がフレーム間に位置ずれがある場合であっても、フレーム組立体を後の工程において、位置決め及び位置決め解除を共に円滑に行うことが出来る。従って、フレーム組立体の流れが中断することが無く、よって、フレーム組立体を用いた半導体装置を効率良く生産出来る。

【0084】またフレームの変形が生ぜず、後工程を精度良く行うことが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体装置の製造方法の一実施例の工程図である。

【図2】本発明の製造方法によって製造された半導体装置の構造を示す図である。

【図3】ステージフレームを示す図である。

【図4】リードフレームを示す図である。

【図5】ステージフレームとリードフレームとを対応させて概略的に示す図である。

【図6】図1中の工程102を説明する図である。

【図7】図1中の工程103を説明する図である。

【図8】フレーム組立体を示す図である。

【図9】図1中の工程105を説明する図である。

【図10】図1中の工程107を説明する図である。

【図11】図1中の工程109を説明する図である。

【図12】フレームが位置ずれなく接合された場合の、後工程位置決め用ガイドホールと逃がし穴との関係を示す図である。

【図13】フレームが位置ずれして接合された場合の、後工程位置決め用ガイドホールと逃がし穴との関係を示す図である。

【図14】第1の変形例を示す図である。

【図15】第3の変形例を示す図である。

【図16】従来の半導体装置の製造方法の1例の工程図である。

【図17】特開昭59-66157号に示されている半導体装置を示す図である。

【図18】ステージフレームを示す図である。

【図19】リードフレームを示す図である。

【図20】ステージフレームとリードフレームとを対応させて概略的に示す図である。

【図21】図16中工程22及び工程23を説明する図である。

【図22】フレーム同士を接合したフレーム組立体を示す図である。

【図23】図16中の工程25を説明する図である。

【図24】図16中の工程27を説明する図である。

【図25】図16中の工程29を説明する図である。

【図26】図16中、工程22、23におけるガイドホールの位置ずれ状態を示す図である。

【図27】積重ガイドホールを示す図である。

【符号の説明】

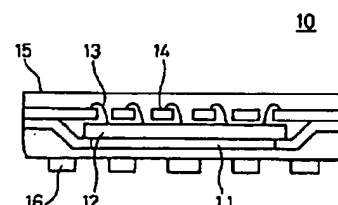
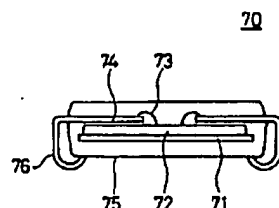
- 70 半導体装置
- 71, 81 ステージ
- 72 半導体チップ
- 73 ワイヤ
- 74, 91 インナーリード
- 75 樹脂パッケージ
- 76, 92 アウターリード
- 80 ステージフレーム
- 82, 85, 93, 96 クレイドル部
- 83, 86, 94, 97 接合位置決め用ガイドホール
- 84, 87 逃がし穴
- 90 リードフレーム
- 95, 98 後工程位置決め用ガイドホール
- 120 フレーム接合装置
- 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ガイドピン
- 123 接合箇所
- 124 フレーム組立体
- 125 ワイヤボンディング装置
- 130 樹脂成形金型
- 133 リード整形装置
- 140, 141 隙間

【図2】

【図17】

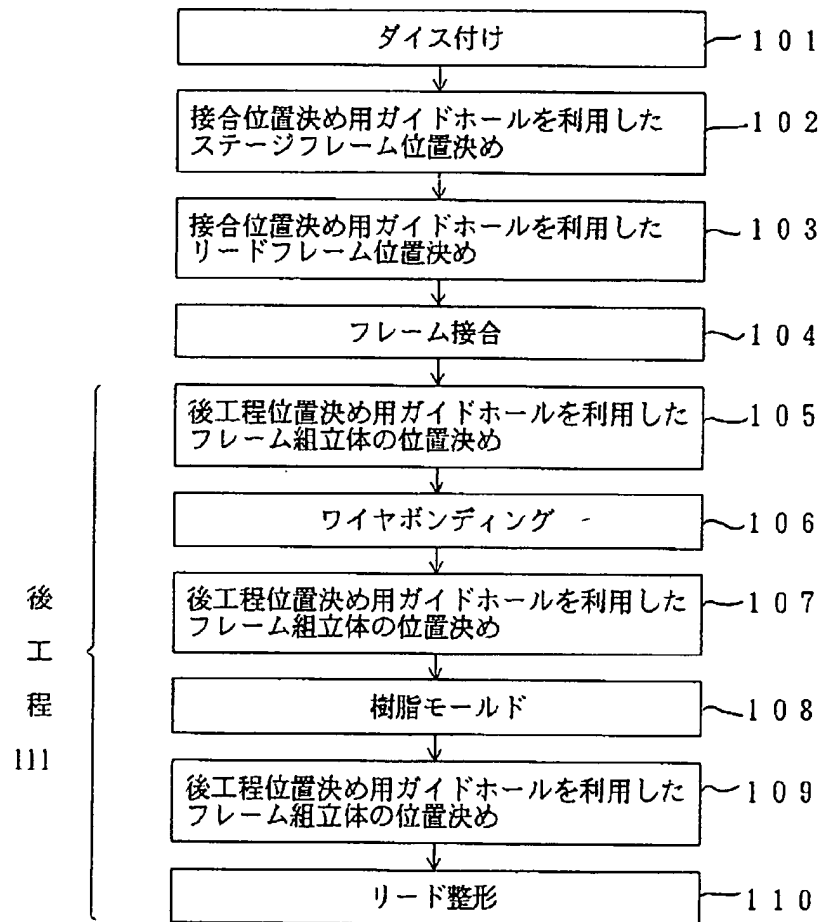
本発明の製造方法によって製造された半導体装置の構造を示す図

特開昭59-66157号に示されている半導体装置を示す図



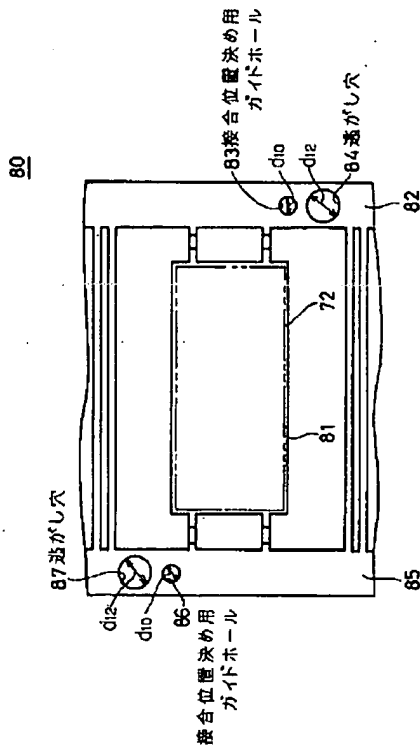
【図 1】

本発明の半導体装置の製造方法の一実施例の工程図



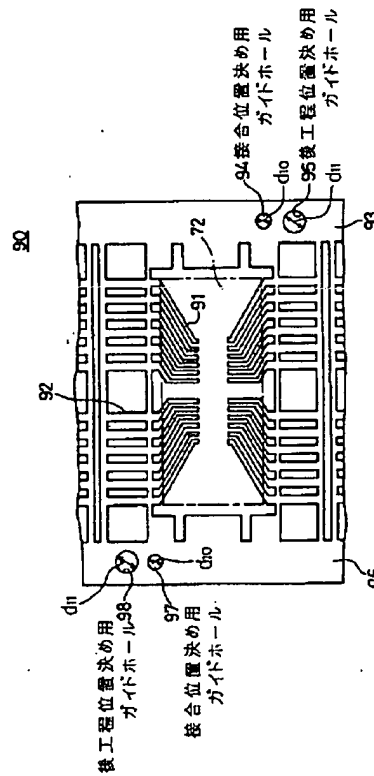
【図3】

ステージフレームを示す図



【図4】

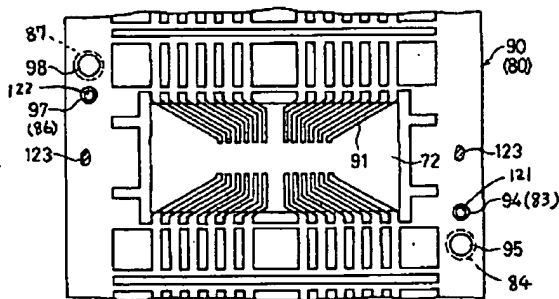
リードフレームを示す図



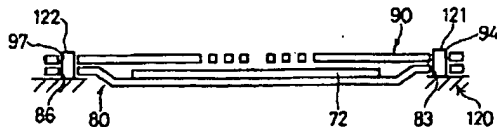
【図7】

図1中の工程103を説明する図

(A)



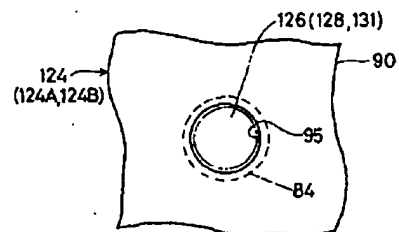
(B)



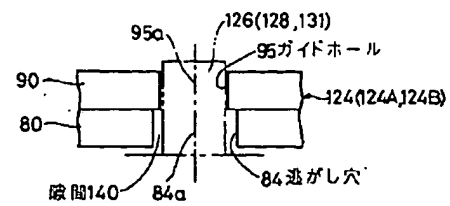
【図12】

フレームが位置ずれなく接合された場合の後工程位置決め用ガイドホールと逃がし穴との関係を示す図

(A)

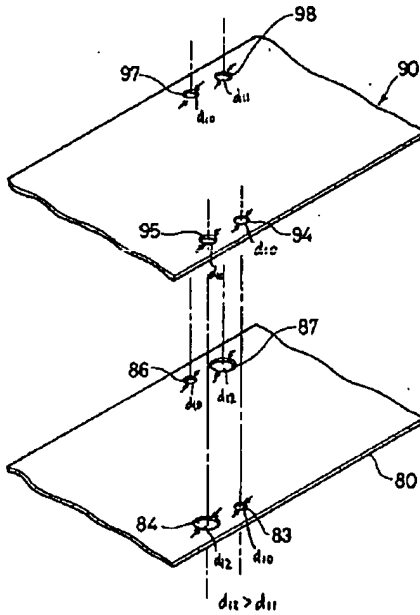


(B)



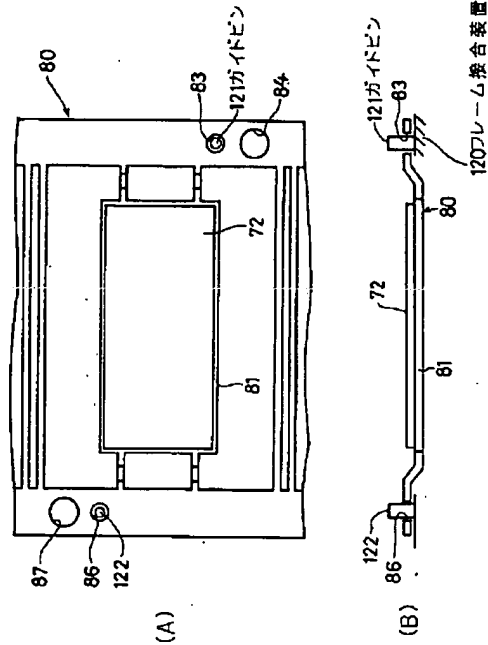
【図5】

ステージフレームとリードフレームとを対応させて
概略的に示す図



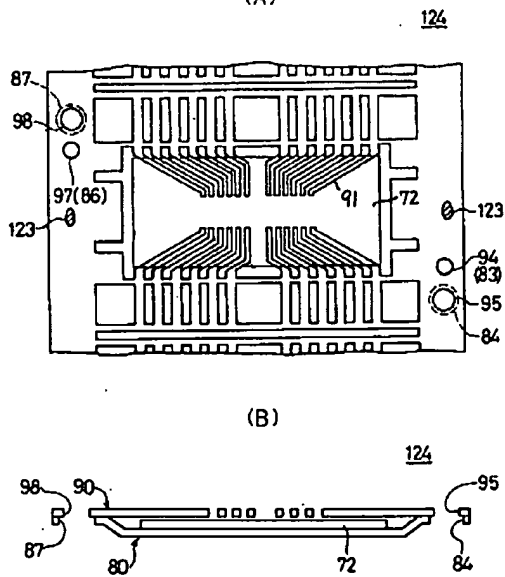
【図6】

図1中の工程102を説明する図



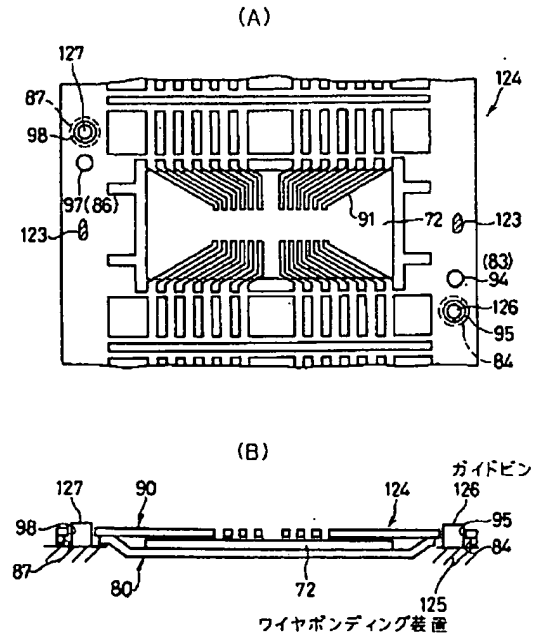
【図8】

フレーム組立体を示す図



【図9】

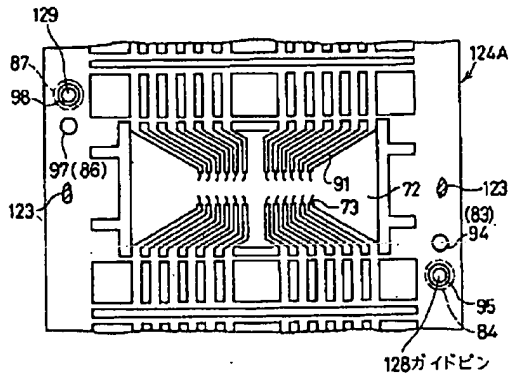
図1中の工程105を説明する図



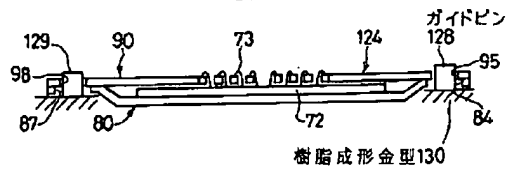
【図10】

図1中の工程107を説明する図

(A)



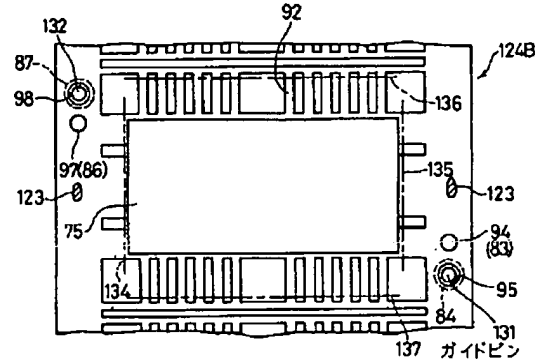
(B)



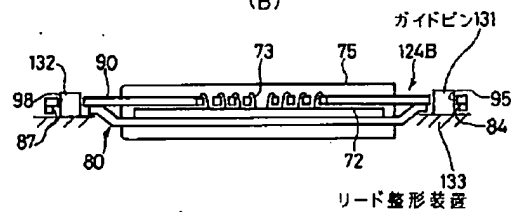
【図11】

図1中の工程109を説明する図

(A)

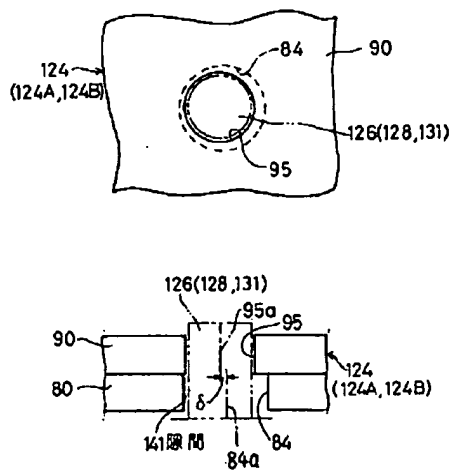


(B)



【図13】

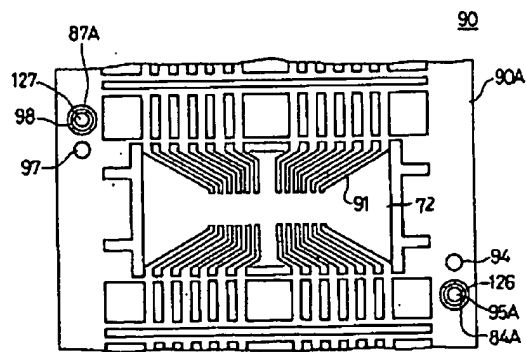
フレームが位置ずれて接合された場合の
後工程位置決め用ガイドホールと逃がし穴
との関係を示す図



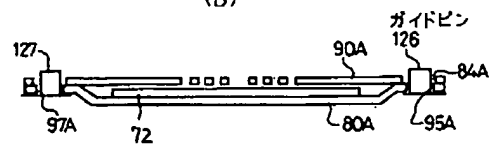
【図14】

第1の変形例を示す図

(A)

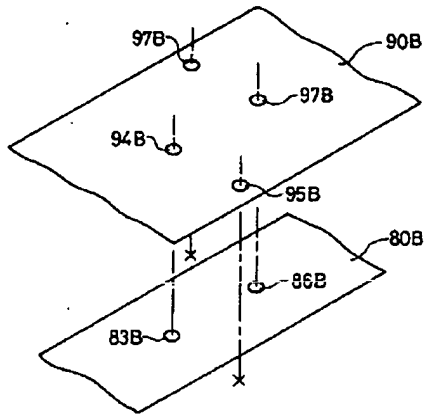


(B)



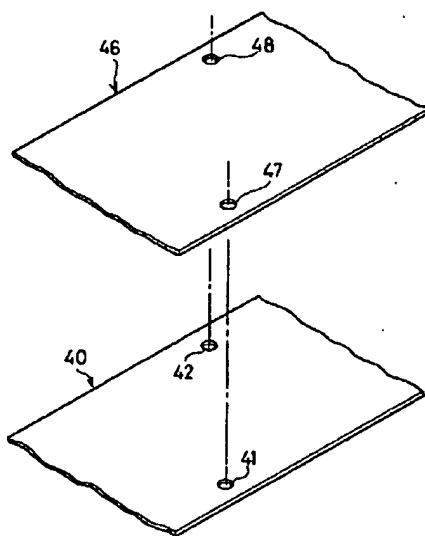
【図15】

第3の変形例を示す図



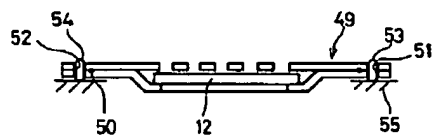
【図20】

ステージフレームとリードフレームとを対応させて概略的に示す図



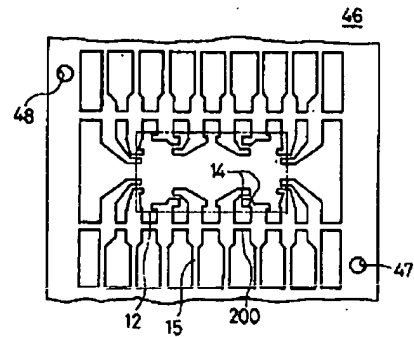
【図23】

図16中の工程25を説明する図



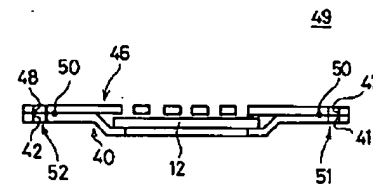
【図19】

リードフレームを示す図



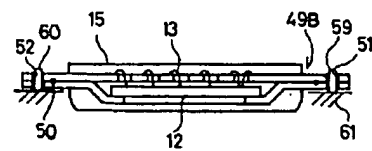
【図22】

フレーム同士を接合したフレーム組立体を示す図



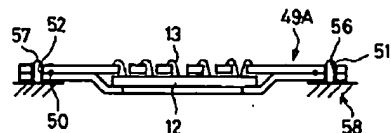
【図25】

図16中の工程29を説明する図



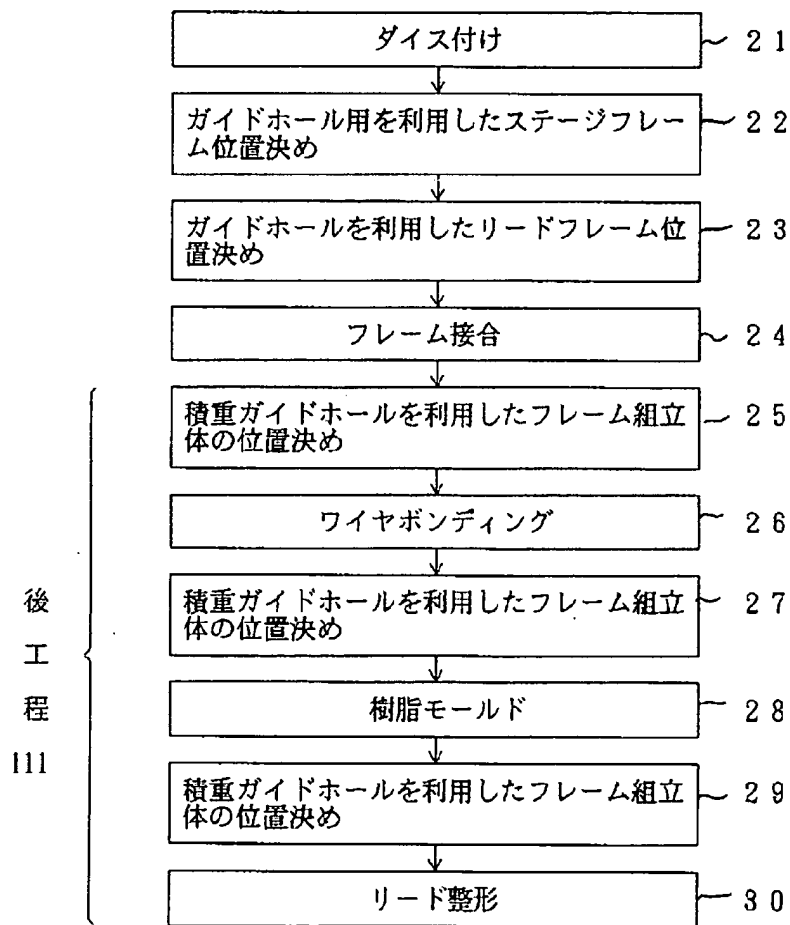
【図24】

図16中の工程27を説明する図



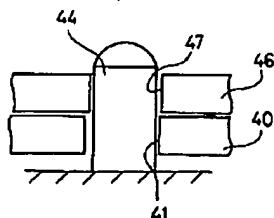
【図16】

従来の半導体装置の製造方法の1例の工程図



【図26】

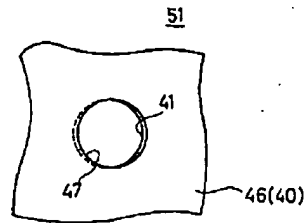
図16中、工程22,23におけるガイドホールの位置ずれ状態を示す図



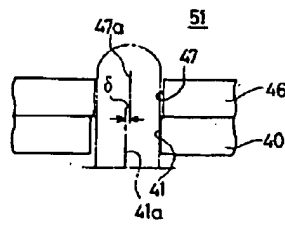
【図27】

積重ガイドホールを示す図

(A)



(B)



フロントページの続き

(72)発明者 大澤 満洋
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

DERWENT-ACC-NO: 2000-553259

DERWENT-WEEK: 200051

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION
LTD

TITLE: Semiconductor chip and lead
frame connection structure
used in lead on chip type package
manufacture, has
bonding stage with pilot pin that is
fitted into position
regulation hole of lead frame

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA
ELECTRONICS CORP[MATE]

PRIORITY-DATA: 1999JP-0017464 (January
26, 1999)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE
LANGUAGE	PAGES
JP 2000216173 A	August 4, 2000

N/A 005 H01L 021/52

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO APPL-DATE

JP2000216173A N/A

1999JP-0017464 January 26, 1999

INT-CL (IPC): H01L021/52

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000216173A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - The semiconductor chip (8) and lead frame (11) are bonded using bonding stage. The bonding stage has a pilot pin (6) which is fitted in position regulation hole (12) of lead frame. During alignment of semiconductor chip and lead frame, pilot pin is fitted in the hole and lead frame is pushed horizontally.

USE - In manufacturing process of lead on chip (LOC) type package.

ADVANTAGE - Since pilot pin is fitted to position regulation hole of the lead frame, mechanical alignment of semiconductor chip and lead frame is done easily and mechanism of semiconductor device manufacturing apparatus is simplified and price of LOC package is reduced.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the top view of lead frame and semiconductor chip connection structure.

Pilot pin 6

Semiconductor chip 8

Lead frame 11

Position regulation hole 12

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/5

TITLE-TERMS: SEMICONDUCTOR CHIP LEAD
FRAME CONNECT STRUCTURE LEAD CHIP
TYPE

PACKAGE MANUFACTURE BOND

STAGE PILOT PIN FIT POSITION REGULATE
HOLE

LEAD FRAME

DERWENT-CLASS: U11

EPI-CODES: U11-D03A2;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers:
N2000-409687

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-216173

(P2000-216173A)

(43) 公開日 平成12年8月4日(2000.8.4)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード(参考)

H 0 1 L 21/52

H 0 1 L 21/52

F 5 F 0 4 7

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平11-17464

(22) 出願日 平成11年1月26日(1999.1.26)

(71) 出願人 000005843

松下電子工業株式会社

大阪府高槻市幸町1番1号

(72) 発明者 増井 浩司

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業株式会社内

(72) 発明者 田中 智之

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業株式会社内

(74) 代理人 100077931

弁理士 前田 弘 (外1名)

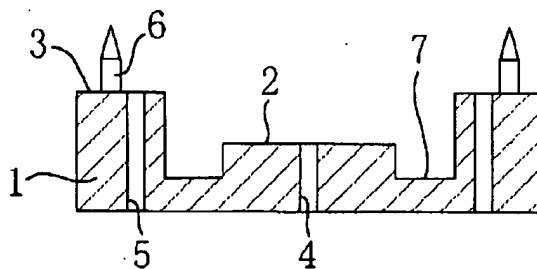
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造装置

(57) 【要約】

【課題】 リードフレームの位置規制のためのパイロットピンを設けることにより、シンプルで安価な半導体装置の製造装置を提供する。

【解決手段】 本発明の半導体装置の製造装置におけるボンディングステージ1は、半導体チップを真空吸着可能なチップ搭載面2とリードフレーム当接面3とを有している。また、リードフレーム当接面3上には、リードフレームの位置規制孔に一定のクリアランスをもって嵌合するパイロットピン6が設けられている。パイロットピン6をリードフレームの位置規制孔に係合させることで半導体チップとリードフレームの位置合わせを容易に機械的に行なうことが可能となる。また、半導体装置の製造装置の機構が簡素化され、かつ、価格を低減することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体チップとリードフレームとを接着固定するためのボンディングステージを備えた半導体装置の製造装置であって、

上記ボンディングステージは、上記リードフレームの位置規制孔に嵌合可能なパイロットピンを備えていることを特徴とする半導体装置の製造装置。

【請求項2】 請求項1に記載の半導体装置の製造装置において、

上記パイロットピンは一定のクリアランスをもって上記 10 リードフレームの位置規制孔に嵌合し、

上記リードフレームの位置規制孔に上記パイロットピンを係合させることにより上記半導体チップと上記リードフレームとの位置合わせを行う際に、上記リードフレームを水平に押す機構を有していることを特徴とする半導体装置の製造装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、LOC型パッケージの製造工程における半導体チップをリードフレームに 20 接着固定するダイ・ボンディング工程に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、主としてメモリーデバイスに代表される半導体チップのパッケージ方式として、インナーリードを半導体チップの回路形成面上にまで延長し、半導体チップ中央部に設けられた電極パッドとインナーリードとの間でワイヤー・ボンディングを行う方式、いわゆるLOC（リード・オン・チップ）型パッケージ方式が採用されている。

【0003】このLOC型パッケージ方式における製造工程の1つに、ダイジグによって個々に分離された半導体チップをリードフレームに接着固定するダイ・ボンディング工程がある。このダイ・ボンディング工程では、従来は、画像認識装置を用いて計測された半導体チップとリードフレームとの双方の位置に基づき、ボンディングステージに設けられた駆動機構によりボンディングステージの位置を補正することによって、半導体チップとリードフレームとの位置合わせを個別に行っていた。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来の半導体装置の製造装置においては、画像認識装置が必要なこと、ボンディングステージに位置補正用の駆動機構が必要なことにより、製造装置の機構が複雑かつ高価になるという問題があった。また、認識ミスにより装置の稼動が停止するという問題もあった。

【0005】本発明の目的は、ボンディングステージにリードフレームの位置規制のためのパイロットピンを設けることにより、シンプルで安価な半導体装置の製造装置を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明の半導体装置の製造装置は、半導体チップとリードフレームとを接着固定するためのボンディングステージを備えた半導体装置の製造装置であって、上記ボンディングステージは、上記リードフレームの位置規制孔に嵌合可能なパイロットピンを備えている。

【0007】これにより、パイロットピンをリードフレームの位置規制孔に係合させることで半導体チップとリードフレームの位置合わせを容易に機械的に行なうことが可能となる。しかも、半導体チップやリードフレームの位置を計測するための画像認識装置やボンディングステージを位置補正するための駆動機構が不要となり、半導体装置の製造装置の機構が簡素化され、かつ、価格を低減することができる。

【0008】上記半導体装置の製造装置において、上記パイロットピンを一定のクリアランスをもって上記リードフレームの位置規制孔に嵌合させ、上記リードフレームの位置規制孔に上記パイロットピンを係合させることにより上記半導体チップと上記リードフレームとの位置合わせを行う際に、上記リードフレームを水平に押す機構を設けることにより、パイロットピンとリードフレームの位置規制孔とのクリアランスを一定の位置に片寄せすることが可能となるため位置合わせの精度をより安定化させることができる。また、半導体装置の製造装置の機構が簡素化され、かつ、価格をさらに低減することができる。

【0009】

【発明の実施の形態】本発明は、ダイジグによって個々に分離された半導体チップをリードフレームに接着固定するダイ・ボンディングという工程に関するものである。

【0010】以下、本発明の実施形態について、図1及び図2を参照しながら説明する。ここで図1は本発明の実施形態に係る半導体装置の製造装置の断面図、図2は本発明の半導体装置の製造装置において、チップ搭載面に半導体チップが搭載され、リードフレーム当接面にリードフレームが当接されている状態の平面図である。

【0011】図1及び図2に示すように、本発明の半導体装置の製造装置におけるボンディングステージ1は、半導体チップが搭載されるチップ搭載面2と、リードフレームが当接されるリードフレーム当接面3とを有している。そのリードフレーム当接面3はチップ搭載面2を取り囲み、かつ、チップ搭載面2より高さ位置が上にある。また、チップ搭載面2とリードフレーム当接面3には、ボンディングステージ1を貫通する真空吸着孔4、5の上端がそれぞれ開口している。また、リードフレーム当接面3の上には、リードフレームの位置規制孔に嵌合可能なパイロットピン6が設けられている。さらに、チップ搭載面2は半導体チップ面のサイズより小さく作

られている。また、チップ搭載面2の周囲には溝7が設けられている。ただし、図1ではパイロットピン6を便宜上表示したが、I-I線における断面にはパイロットピン6は現実には存在しない。

【0012】図3は、本発明の半導体装置の製造装置に使用されるリードフレームの平面図である。同図に示すように、リードフレームは半導体チップとリードフレームとを接着固定するための固定用リード13、14と、半導体チップの外周部に近接して配置されかつ半導体チップの中央付近まで延びる多数のインナーリード15と、各インナーリード15の後端から導出され、インナーリード15と同数であるアウターリード16と、各アウターリード16の先端を順次接続するダムバー17と、各アウターリード16の後端を順次接続する四角形の外枠18a~dとを備えている。上記ダムバー17は、各々外枠18a、bに平行な2辺からなる。

【0013】ここで、上記固定用リード13、14は合計6箇所（箇所）に設けられている。そのうち4箇所（箇所）（固定用リード13）は、両端のインナーリード15から導出されており、かつ、インナーリード15と外枠18c、dとの間に設けられている。残りの2箇所（箇所）（固定用リード14）は、多数のインナーリード15のうち中央にあるインナーリードの先端から、リードフレームの中心に向かって、導出されている。これら6箇所の固定用リード13、14により、半導体チップとリードフレームとを確実に接着固定することができる。ただし、固定用リードの位置は上述の位置に限定されるものでないことはいまでもない。

【0014】次に、本発明の半導体装置の製造装置における半導体チップとリードフレームとの接着固定の手順について説明する。

【0015】まず、図4(a)に示すように、ボンディングステージ1のチップ搭載面2上に半導体チップ8を載置し、チップ真空吸着孔4から真空ポンプ（図示せず）により真空吸着を行って半導体チップ8を固定する。これにより、半導体チップ8の不要な上下左右への移動を防止する。

【0016】そして、図4(b)に示すように、半導体チップ8上の所定の位置、すなわちリードフレームとの接着箇所に接着剤9をディスペンスノズル10により塗布する。ただし、リードフレーム側の接着部にあらかじめ接着剤を付けたリードフレームを用いる場合には、図4(b)に示すような半導体チップ上への接着剤の塗布は行わないものとする。

【0017】次に、図4(c)に示すように、リードフレーム11の位置規制孔12をパイロットピン6に係合させ、さらに、リードフレーム横押し機構30によりリードフレーム11を水平に押すことにより、半導体チップ8とリードフレーム11との位置合わせを行う。真空吸着を行ってそのリードフレーム11をリードフレーム

当接面3に固定した後に、接着剤9を硬化させて半導体チップ8とリードフレーム11とを接着固定する。

【0018】本実施形態では、接着剤の種類については説明していないが、例えば、接着剤として熱硬化性接着剤や紫外線硬化性接着剤を用いることが可能であり、その場合においてはそれぞれ加熱手段や紫外線照射手段を用いて各接着剤を硬化させることになる。

【0019】また、図5は、本発明の半導体装置による半導体チップとリードフレームとの接着固定の後に、外部接続のために指定されたインナーリード15と半導体チップ8の電極部19との間で、極細線20によるワイヤー・ボンディングを行った状態を示す平面図である。

【0020】上述のように、本実施形態の製造装置においては、半導体チップ8とリードフレーム11との位置合わせを容易に機械的に行うことができる。また、パイロットピン6とリードフレーム11の位置規制孔12との間のクリアランスを一定の位置に片寄せすることにより、位置合わせの精度をより安定化させることができる。さらに、半導体チップやリードフレームの位置を計測するための画像認識装置やボンディングステージの位置を補正するための駆動機構が不要となり、装置の機構が簡素化され、かつ、価格が低減できるという利点もある。

【0021】なお、本発明の半導体装置の製造工程に代えて、ボンディングステージ1のチップ搭載面2上への半導体チップ8の載置、固定の後に、ロータリー搬送装置によりボンディングステージ1を移動させることにより、1つのディスペンスノズル10を用いて、所定の数箇所の接着箇所に接着剤9を塗布するようにしてもよい。この場合には、ボンディングステージ1のリードフレーム当接面3上へのリードフレーム11の載置、固定の後に、ボンディングステージ1を移動させることにより、接着剤を硬化させるため、紫外線を上記接着箇所に照射することとなる。

【0022】また、リードフレーム11の位置規制孔12の形状は特定のものに限定されない。例えば、位置規制孔12の形状として、円、三角円等を採用することができる。

【0023】

【発明の効果】以上に説明したように本発明の半導体装置の製造装置によれば、パイロットピンをリードフレームの位置規制孔に係合させることで半導体チップとリードフレームの位置合わせを容易に機械的に行なうことが可能となる。また、半導体装置の製造装置の機構が簡素化され、かつ、価格を低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施形態に係る半導体装置の製造装置の断面図であって、図2のI-I線における断面図である。

【図2】実施形態に係る半導体装置の製造装置において、チップ搭載面に半導体チップが搭載され、リードフ

レーム当接面にリードフレームが当接されている状態の平面図である。

【図3】実施形態に係る半導体装置の製造装置に使用されるリードフレームの平面図である。

【図4】実施形態に係る半導体装置の製造装置における半導体チップとリードフレームとの接着固定の手順を示す断面図である。

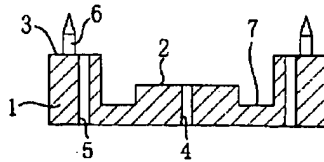
【図5】実施形態によるダイ・ボンディング後、ワイヤー・ボンディングを行った後の半導体装置の平面図である。

【符号の説明】

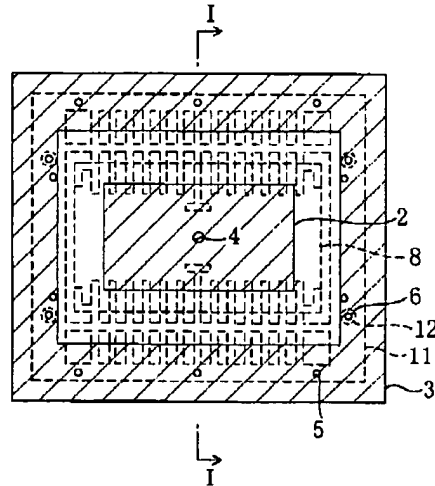
- 1 ボンディングステージ
- 2 チップ搭載面
- 3 リードフレーム当接面
- 4 チップ真空吸着孔
- 5 リードフレーム真空吸着孔

- 6 パイロットピン
- 7 溝
- 8 半導体チップ
- 9 接着剤
- 10 ディスペンスノズル
- 11 リードフレーム
- 12 位置規制孔
- 13 固定用リード
- 14 固定用リード
- 15 インナーリード
- 16 アウターリード
- 17 ダムバー
- 18 外枠
- 19 電極部
- 20 極細線
- 30 リードフレーム横押し機構

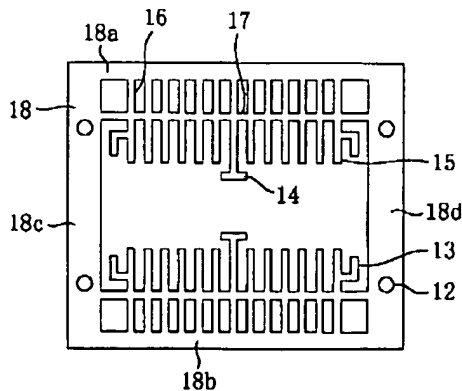
【図1】



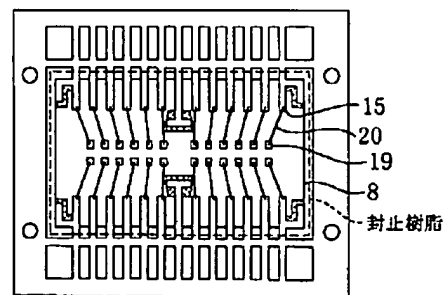
【図2】



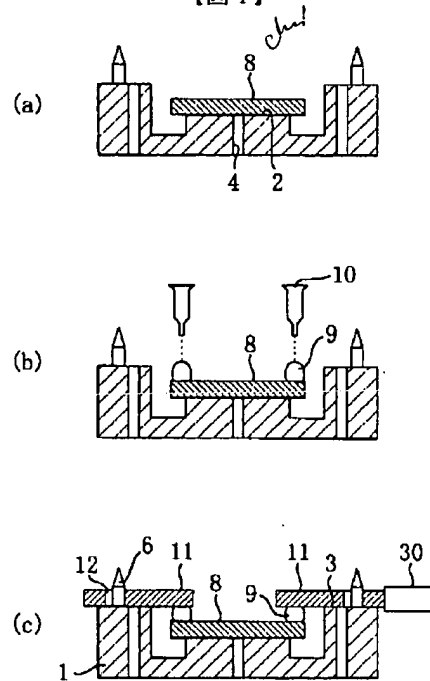
【図3】



【図5】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 田村 佳和
 大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業
 株式会社内
 (72)発明者 田中 彰一
 大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業
 株式会社内

(72)発明者 村山 次雄
 大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業
 株式会社内
 Fターム(参考) 5F047 AA11 BA21 BB11 BB18 FA08
 FA22 FA32